

06;07

©1993 г.

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ $\text{CdS}\langle\text{In}\rangle\text{CuInSe}_2$

*Н.Н. Константинова, А.В. Лунев, М.А. Магомедов, Ю.В. Рудь,
Т.Н. Ушакова*

Получены и исследованы фоточувствительные структуры, представляющие собой гетероконтакт пленки $p\text{-CuInSe}_2$ ($d < 5$ мкм, магнетронное распыление из одной мишени) с пленкой $n\text{-CdS}\langle\text{In}\rangle$ ($d < 4$ мкм, вакуумное термическое распыление). Гетероструктуры обладают токовой фоточувствительностью 5 мА/Вт в спектральном диапазоне между ширинами запрещенных зон CuInSe_2 и CdS . Термообработка пленочных гетероструктур в вакууме в области 200–400° С трансформирует спектральный контур фоточувствительности, что связывается с компенсацией CdS за счет диффузии меди из узкозонной компоненты гетероструктуры.

Диселенид меди и индия является прямозонным полупроводником со структурой типа халькопирита и вызывает интерес для применения в солнечной фотоэнергетике, поскольку обладает идеальной для таких устройств шириной запрещенной зоны ($E_g = 1.03$ эВ при 300 К) и высоким значением коэффициента поглощения во всем спектральном диапазоне солнечного излучения ($\alpha > 10^5$ см⁻¹) [1,2]. Особые надежды связываются с использованием CuInSe_2 в тонкопленочных солнечных элементах [2]. Поэтому наблюдается расширение экспериментальных исследований метода получения тонких пленок CuInSe_2 и управление их свойствами. В данной работе сообщается о выращивании тонких поликристаллических пленок $p\text{-CuInSe}_2$ методом магнетронного напыления и создания на их основе фоточувствительных гетероструктур $n\text{-CdS}-p\text{-CuInSe}_2$.

1. Пленки CuInSe_2 получены посредством известного метода магнетронного распыления [2] предварительно синтезированной поликристаллической мишени из нелегированного CuInSe_2 (концентрация свободных носителей заряда $p = 10^{17} - 10^{18}$ см⁻³, проводимость n - или p -типа) при постоянном токе в атмосфере Ar (ОСЧ) на установке типа ВУП-5. Для напыления применялся кольцевой магнетрон ЕММ-60 с электромагнитным возбуждением, что позволяло регулировать величину магнитного поля на поверхности мишени (диаметр 60 мм, толщина до 3 мм) в диапазоне 0–100 мТс. При напылении пленок сложного атомного состава использовали следующий механизм ионного распыления. Ионизированные атомы Ar^+ , бомбардируя поверхность мишени, находящейся под отрицатель-

ным смещением (до -600 В), выбивают из нее атомы исходного вещества согласно индивидуальным коэффициентам распыления, что в принципе порождает несоответствие составов конденсированной пленки и исходной мишени. Однако при достаточно высоких энергиях Ar^+ и постоянстве токов ($10\text{--}30 \text{ mA/cm}^2$) на поверхности мишени образуется аморфный микст-слой, в котором за счет перемешивания атомов осуществляется эффективная гомогенизация с последующим распылением вещества. В принципе микст-слой обедняется легко “выбиваемыми” атомами, в нем устанавливается динамическое равновесие между процессами удаления атомов из слоя вследствие ионной бомбардировки и поступлением в него атомов из мишени. Если размеры флюктуаций атомного состава мишени не превышают толщину микст-слоя ($100\text{--}500 \text{ \AA}$), то достигается соответствие состава распыляемого вещества и мишени. В начале процесса распыления с поверхности мишени удаляется $5\text{--}10$ толщин микст-слоя, в результате чего состав продуктов распыления стабилизируется. Поэтому в наших опытах продукты распыления в первые 10 мин осаждали на заслонку, после чего осаждение вели на поверхность нагретой ($200\text{--}450^\circ \text{C}$) подложки из оптического стекла.

В результате магнетронного напыления воспроизводимо получали пленки CuInSe_2 p -типа проводимости с толщинами до 5 \mu m и удельным сопротивлением в диапазоне $\rho = 0.5\text{--}10^3 \text{ \Omega \cdot cm}$ при 300 K . Поверхность полученных пленок была зеркальной, а сами пленки обнаружили высокую адгезию к поверхности использованных подложек. Согласно данным рентгеновских исследований, полученные пленки имели поликристаллическую структуру и параметры решетки, совпадающие с известными для объемных кристаллов CuInSe_2 [1,2]; микрозондовый рентгеноспектральный анализ подтвердил соответствие атомного состава пленок и мишени. Для получения фоточувствительных структур на зеркальную поверхность электрически однородных пленок $p\text{-CuInSe}_2$ без какой-либо предварительной обработки методом вакуумного термического осаждения при температурах $150\text{--}200^\circ \text{C}$ наносили через маски слои $n\text{-CdS(} \text{In})$. Толщина слоев $\text{CdS(} \text{In})$ достигала $1\text{--}2 \text{ \mu m}$ ($\rho = 0.2\text{--}0.5 \text{ \Omega \cdot cm}$, $n = 1\text{--}5 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ при 300 K), а сами слои обладали высокой адгезией к поверхности CuInSe_2 . В качестве омических контактов применяли индий к CdS и золото к CuInSe_2 .

2. Исследованные пленочные гетероструктуры представляли собой контакт нанесенных магнетронным напылением на снабженное слоем молибдена ($\sim 5 \text{ \mu m}$) оптическое стекло пленок $p\text{-CuInSe}_2$ и $n\text{-CdS(} \text{In})$ (вставка на рис. 1). Площадь гетерограницы обычно составляла $\approx 1 \text{ cm}^2$. Исследования стационарных вольт-амперных характеристик показали, что пленочные $n\text{-}p$ -гетероструктуры обнаруживают выпрямление $\lesssim 5$ при $U \approx 1 \text{ V}$, причем пропускное направление всегда отвечает минусу внешнего смещения на CdS . Проверка гетероконтакта аналогичных пленок $\text{CdS(} \text{In})$ с поверхностью поликристаллических пластин $p\text{-CuInSe}_2$ с концентрацией дырок $\approx 1\text{--}5 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ показала, что в этом случае получаются структуры с выпрямлением $\sim 10^3$. Поэтому есть основания считать, что наблюдаемое выпрямление пленочных гетероструктур обусловлено недостаточным совершенством пленок $p\text{-CuInSe}_2$. В таких пленках эффект Холла, как правило, не удается зарегистрировать, что, по-видимому, обусловлено сильной компенсацией присутствующих в пленках дефектов решетки. Последнее, вероятно, обуславливает высокое сопротивление структур $R_T = 10^3\text{--}10^5 \text{ \Omega}$ при 300 K .

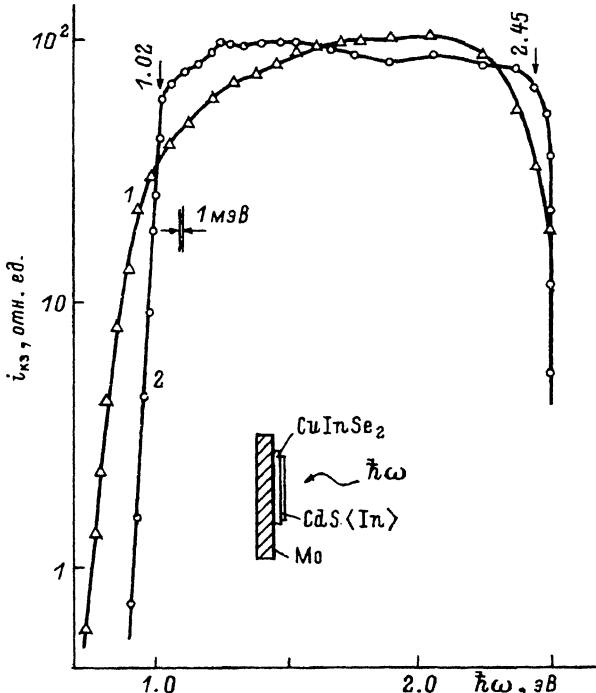


Рис. 1. Спектральные зависимости фоточувствительности гетероструктур n -CdS(In)- p -CuInSe₂ при $T = 300$ K, освещение со стороны CdS.

1 — пленочная структура на стекле, образец 19, $d(\text{CdS})=3.1$ мкм, $d(\text{CuInSe}_2)=3.2$ мкм;

2 — пленка CdS(In) нанесена на подложку из поликристаллического CuInSe₂, образец 4, $d(\text{CdS})=2$ мкм, $d(\text{CuInSe}_2)=0.2$ мм. На вставке конструкция пленочной структуры.

3. При освещении пленочных гетероструктур наблюдается фотовольтаический эффект, причем пленки CdS всегда заряжаются отрицательно в соответствии с энергетической диаграммой контакта этих веществ, а знак фотонаряжения не зависит от места попадания светового зонда на структуру и энергии падающих фотонов. Токовая фоточувствительность лучших структур достигает 5 mA/Bт и максимальна при освещении со стороны широкозонной компоненты.

На рис. 1 приведена типичная спектральная зависимость фототока короткого замыкания $i_{\text{кз}}$ непосредственно после получения пленочной гетероструктуры (кривая 1) в сравнении с аналогичной характеристикой полупленочной структуры (кривая 2). Видно, что спектральная зависимость фототока в обеих структурах сходная и перекрывает диапазон между ширинами запрещенных зон CuInSe₂ и CdS. Коротковолновая граница обусловлена началом прямых переходов в материале широкозонного окна, тогда как длинноволновая определяется прямыми переходами в CuInSe₂. Тот факт, что в тонкопленочной структуре фундаментальный край фотоактивного поглощения CuInSe₂ смешен в длинноволновую область относительно характерного для гетероструктуры на основе объемного поликристаллического p -CuInSe и одновременно в спектрах $i_{\text{кз}}$ исчезает особенность в виде излома при $\hbar\omega = 1.02$ эВ (рис. 1, кривая 2), имеет очевидную связь с более низким качеством пленочного CuInSe₂ относительно объемного вещества вследствие повышения степени компенсации.

На рис. 2 представлена типичная нагрузочная характеристика для одной из тонкопленочных гетероструктур при освещении естественным интегральным излучением от лампы накаливания. Фактор заполнения

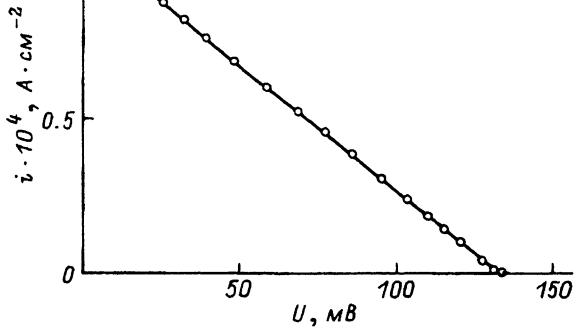


Рис. 2. Нагрузочная характеристика тонкопленочной гетероструктуры $n\text{-CdS}(\text{In})-p\text{-CuInSe}_2$.
 $T = 300\text{ K}$, освещение со стороны CdS, образец 19, $d(\text{CdS})=3.1\text{ мкм}$, $d(\text{CuInSe}_2)=3.2\text{ мкм}$; лампа накаливания $L = 2\text{ мВт}/\text{см}^2$.

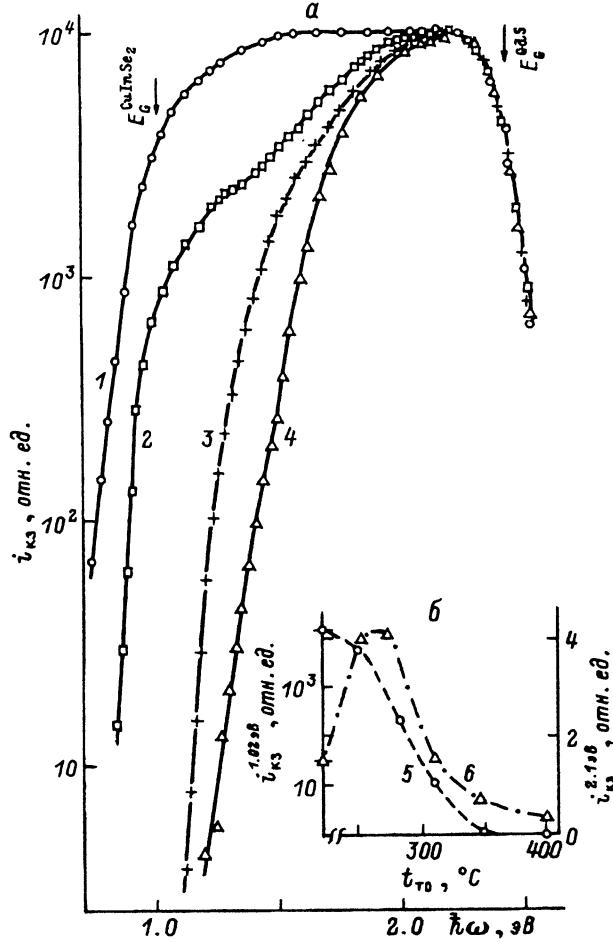


Рис. 3.

a — влияние температуры изохронной термообработки на спектральные зависимости фототока гетероструктур $n\text{-CdS}(\text{In})-p\text{-CuInSe}_2$ при $T = 300\text{ K}$, освещение со стороны CdS, образец 16, $d(\text{CdS})=2.4\text{ мкм}$, $d(\text{CuInSe}_2)=3.6\text{ мкм}$, $\tau = 10\text{ мин}$; $t_{T0}, {}^\circ\text{C}$: 1 — исходный образец, 2 — 250, 3 — 350, 4 — 400;
b — зависимость фоточувствительности от температуры изохронной термообработки гетероструктур $n\text{-CdS}(\text{In})-p\text{-CuInSe}_2$, образец 16; 5 — $\hbar\omega = 1.02$, 6 — 2.1 eV .

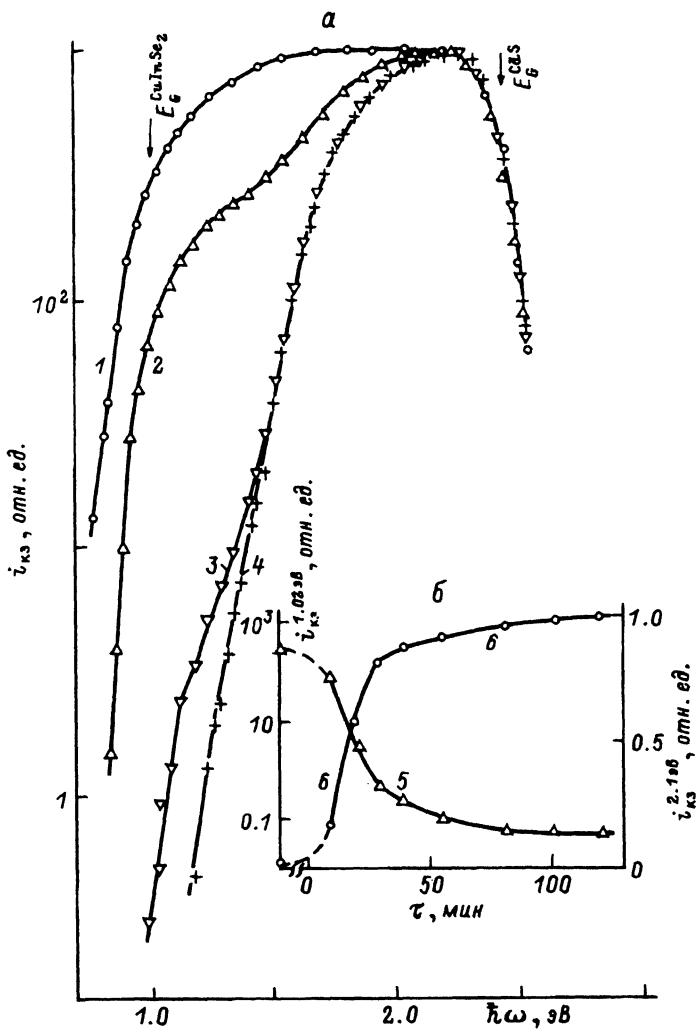


Рис. 4.

a — влияние времени изотермической термообработки на спектральные зависимости фототока гетероструктур n -CdS(In)- p -CuInSe₂ при $T = 300\text{ K}$, освещение со стороны CdS, образец 17, $d(\text{CdS})=2.0\text{ мкм}$, $d(\text{CuInSe}_2)=4.2\text{ мкм}$, $t_{t_0} = 250^\circ\text{ C}$; τ , мин: 1 — исходный образец, 2 — 10, 3 — 30, 4 — 120;

б — зависимости фоточувствительности от времени изотермической термообработки гетероструктуры n -CdS(In)- p -CuInSe₂ при $T = 300\text{ K}$, образец 17; 5 — $\hbar\omega = 1.02$, 6 — 2.1 эВ .

нагрузочной характеристики таких структур составляет обычно $=0.25$. Фотонапряжение холостого хода для лучших пленочных гетероструктур достигает -320 мВ , а фототок короткого замыкания -0.1 mA/cm^2 при $T = 30\text{ K}$. Повышение величины i_{K3} обычно сопровождается понижением U_{xx} .

4. На полученных пленочных структурах изучалось также влияние последующей термообработки на их фотоэлектрические свойства. На рис. 3,*a* представлены типичные спектральные зависимости фоточувствительности одной из гетероструктур при различных температурах термо-

обработки $t_{\text{то}}$. Видно, что с повышением величины $t_{\text{то}}$ происходит перестройка спектров фоточувствительности, состоящая в понижении вклада фотоактивного поглощения веществом узкозонной пленки. Так, уже при достижении $t_{\text{то}} = 400^\circ\text{C}$ фоточувствительность гетероструктуры доминирует в области поглощения широкозонной пленкой CdS. Из рис. 3,б можно видеть, что фоточувствительность в области межзонного поглощения в CuInSe₂ при достижении $t_{\text{то}} = 400^\circ\text{C}$ падает на 4 порядка величины относительно исходного значения. В области межзонного поглощения в CdS фоточувствительность гетероструктур в зависимости от температуры в окрестности $t_{\text{то}} = 200^\circ\text{C}$ проходит через максимум, что может свидетельствовать о совершенствовании кристаллической структуры гетерограницы и объема пленки CdS⟨In⟩.

Изотермическая термообработка гетероструктур в области температур, при которых повышается фоточувствительность, также сопровождается спектральной перестройкой $i_{\text{кз}}$ (рис. 4,а). Эта перестройка состоит в том, что с ростом времени термообработки происходит увеличение фоточувствительности, связанной с поглощением излучения в широкозонной пленке и соответственно снижением фотоактивного поглощения в узкозонной пленке. Из рис. 4,б можно видеть, что понижению фоточувствительности в области $hw = 1.02\text{ эВ}$ сопутствует повышение фоточувствительности при $hw = 2.1\text{ эВ}$. Временные зависимости $i_{\text{кз}}$ имеют вид кривых с насыщением. Время достижения равновесного состояния существенно растет с понижением температуры термообработки. Так, если при $t_{\text{то}} = 250^\circ\text{C}$ процесс резкого увеличения $i_{\text{кз}}$ при $hw = 2.1\text{ эВ}$ длится 30–40 мин, то при $t_{\text{то}} = 200^\circ\text{C}$ длительность этого процесса возрастает до 2–3 час.

Эффект улучшения фотоэлектрических параметров пленочных гетероструктур на основе CuInSe₂ за счет термообработки достаточно хорошо известен [2]. Однако при этом факт спектральной перестройки фоточувствительности еще не обсуждался. Приведенные выше результаты, по-видимому, указывают на то, что при термообработке гетероструктур происходит диффузия меди в пленку CdS, в результате чего может понижаться сопротивление p -CuInSe₂ и повышаться сопротивление n -CdS, что в конечном счете сопровождается смещением активной области гетероструктуры в CdS и соответствующим этому повышением коротковолновой фоточувствительности.

Список литературы

- [1] Shay J.L., Wernick J.H. Ternary Chalcopyrite Semiconductors: Growth, Electronic Properties and Applications. Oxford: Pergamon Press, 1975. 345 p.
- [2] Copper Indium Diselenide for Photovoltaic Applications. Amsterdam: Elsevier, 1986. 640 p.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
9 декабря 1992 г.
В окончательной редакции
21 мая 1993 г.